

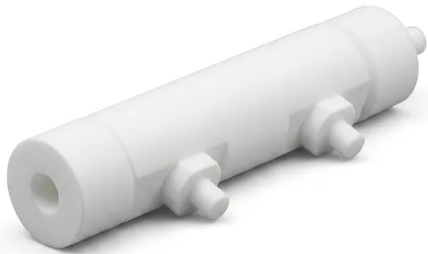
# 定制聚四氟乙烯电解池 耐腐蚀低背景反应容器 带进出接口

货号: PL-CP250

## 简介

探索专为精密电化学分析设计的专业高纯定制聚四氟乙烯电解池。该反应容器具有极强耐腐蚀性与低背景干扰特性，可定制进出接口，能够无缝集成于要求严苛的工业或实验室流体系统中。

## 了解更多



应用场景	说明	核心优势
痕量金属分析	分析环境或药物样品中超低浓度金属杂质	零离子浸出，确保背景信号保持在检测限以下
电池研究	测试锂离子和液流电池的下一代电解质和电极材料	对强腐蚀性锂盐和有机碳酸酯溶剂具有优异耐受性
半导体刻蚀	硅片清洗和刻蚀溶液的小规模测试与监测	消除玻璃反应容器常见的硅或硼污染问题
熔盐电解	涉及熔盐或腐蚀性熔融介质的高温电化学反应	最高可承受260°C的热稳定性，可开展专业低温熔盐研究
电镀开发	开发用于珠宝、电子和航空航天部件的精密镀液	坚固结构可耐受酸性电镀添加剂和重复清洁循环
腐蚀测试	对冶金样品开展长期浸泡和电化学阻抗谱（EIS）测试	提供化学中性环境，不会干扰样品的腐蚀剖面
流动化学	集成到连续流系统中，使用腐蚀性试剂合成化学中间体	可定制进出接口，实现精确流体控制与系统集成

规格类别	参数	性能/数值（PL-CP250）
材料性能	主体材料	100% 全新聚四氟乙烯（PTFE）
	颜色	本白色/不透明
	耐化学性	通用耐腐（熔融碱金属、氟气除外）
	工作温度	-200°C 至 +260°C
设计变量	介电强度	≥ 10 kV/mm
	内部容积	可定制（10mL 至 5000mL 以上）
	结构配置	单室、H型电解池或多室结构
	接口连接方式	螺纹（NPT/UNF）、法兰或推入式连接
	进出接口数量	2至8个以上接口（用户定义）
制造工艺	密封机制	聚四氟乙烯螺帽、O型圈密封或研磨接头
	加工方式	高精度CNC加工
	表面光洁度	Ra < 0.8 ¼m（标准）或高抛光
	尺寸公差	± 0.05mm（关键尺寸）